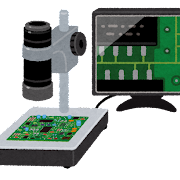
～ものづくり技術人材リスキリング研修～

「 分 析 技 術 全 般 」と「 半 導 体 デ バ イ ス 分 析 」

主催：大分県産業科学技術センター

分析技術を幅広く学ぶ「分析全般コース」と対象を半導体に絞った「半導体デバイス分析コース」の2コースを開講します。

**「分析全般コース」**では、デバイス周辺材料の材料物性評価、無機分析、有機分析、発生ガス分析について、分析手法、原理、装置の概要、分析事例を講義します。**「半導体デバイス分析コース」**では、パワー半導体の構造とよく使われる評価・解析技術を概説した後、各手法の詳細について分析事例を活用し、講義します。

日頃、分析・評価に携わられている方や半導体プロセスに関わる分析に携わられている方でもそれぞれを幅広く分析全般を学ぶ機会は多くありません。担当される分析・評価の周辺の分析・評価技術について幅広く学び直すことによっては、担当する分野への理解が深まります。この機会にベテラン・中堅のリスキリングとして、また、新人研修として、ぜひご受講ください。

**【半導体デバイス分析コース】12/19(火)**

１．パワー半導体の構造とよく使われる評価・解析技術

２．組成・不純物評価法（RBS/HFS, XPS, SIMS)

３．電子顕微鏡を用いた評価法（TEM, SEM)

４．プローブ顕微鏡を用いた評価法（AFM, SPM）

５．光を用いた評価法（FT-IR, RAMAN, PL, CL）

６．熱抵抗・放熱性評価（過渡熱測定）

**【分析全般コース】12/4(月)**

１．デバイス周辺材料の分析技術総論

２．材料物性評価

３．無機分析

４．有機分析

５．発生ガス分析

６．まとめ



1. 日　時： 分析全般コース 令和５年１２月　４日（月）：１０時～１６時

半導体デバイス分析コース 令和５年１２月１９日（火）：１０時～１６時

2. 会　場： オンライン受講　申込者にパスワードなどをご案内します。

＊1)産業科学技術センター研修室でも集合型オンライン受講できます。

＊2)オンライン受講希望者が多い場合、集合受講となる場合があります。オンライン・集合の決定は、後日メールにてお知らせします。

3. 講　師： 株式会社東レリサーチセンター

4. 定　員： 各コース２０名

5. 受講料： 無料

6. 申　込： 11月30日までに、QRコードおよびURL経由、メール、FAXのいずれかでお申し込み下さい。

7. 問合先： 大分県産業科学技術センター 電子情報担当 首藤　工業化学担当 安友

 TEL：097-596-7101、FAX：097-596-7110、E-mail：i-chem【＠】oita-ri.jp

8. 備　考： 1コース受講でも2コース受講でも可能です。

・当日は、セミナーの様子を写真撮影して広報等に使用することがあります。

応募サイト

作成中

QRコードはこちら→

**申　込　書**

※ URL：https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys-alias/handoutai2023

※ 受付完了後、こちらからメール等にてご連絡をいたします。

申込先： 産業科学技術センター 工業化学担当行（FAX：097-596-7110、E-mail： i-chem【＠】oita-ri.jp）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貴社名 | | |  | | |
| 受講者名　（ふりがな） | | | メールアドレス | 受講場所  (分析全般コース) | 受講場所  (半導体デバイス分析) |
| 1 |  | |  | □ オンライン  □ 産科技センター | □ オンライン  □ 産科技センター |
| ２  ※当センターからの情報をメールでお知らせして良いですか？(OIRIメール便への登録)　　はい・いいえ・登録済 |  | |  | □ オンライン  □ 産科技センター | □ オンライン  □ 産科技センター |
|  | |